

上海光学中恒仪器 光切法显微镜9J 光洁度刻线划痕测量

产品名称	上海光学中恒仪器 光切法显微镜9J 光洁度刻线划痕测量
公司名称	上海中恒仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上光 型号:9J
公司地址	中国 上海 上海市杨浦区 上海市大连路1548号18C
联系电话	86-021-65042200 13916693243

产品详情

用途：

光切法显微镜9j是以光切法测量零件加工表面的微观不平度。其能判别国家标准gb1031-1995所规定测量范围1.0~80微米即原标准 3~ 9级表面光洁度。对于表面划痕、刻线或某些缺陷的深度也可用来进行测量。光切法特点是在不破坏表面的状况下进行的。是一种间接测量方法。即要经过计算后才能确定纹痕的不平度。

规格：

测量范围 不平度 平均高度值 (μm)	表面光洁度级 别	所需物镜	总放大倍数	物镜组件工作距离 (mm)	视 场 (mm)
> 0.8 ~ 1.6 > 1.6 ~ 6.3 > 6.3 ~ 20 > 20 ~ 80	98 ~ 76 ~ 54 ~ 3	60 × n.a.0.55 30 × n.a.0.207 14 × n.a.0.12	510 × 260 × 120 × 60 ×	0.040.22.59.5	0.30.61.32.5

测量不平度范围：0.8~80 μm 不平宽度用测微目镜：0.7 μm~2.5 mm 用坐标工作台：0.01~13 mm
仪器重量：约23 kg 外形尺寸：约180 × 290 × 470 mm

仪器成套性：

仪器主体
标准刻尺
60 × 物镜

测微目镜
7 × 物镜
2.1w6v灯泡

坐标工作台
14 × 物镜
可调变压器220/4 ~ 6/5va

v 型块
30 × 物镜

本产品的加工定制是否，品牌是上光，型号是9J，测量范围是0.8 ~ 80 μm ，外形尺寸是180 × 290 × 470 (mm)，重量是28 (kg)